

ВЛИЯНИЕ РЕЗОНАНСНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ НА СВОЙСТВА ГАЗОВОГО РАЗРЯДА, ПОДДЕРЖИВАЕМОГО НЕСИММЕТРИЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОЛНАМИ

*Н.А. Азаренков,
А.В. Гапон,
И.Б. Денисенко*

*Физико-технический факультет, Харь-
ковский государственный университет,
пл. Свободы 4, Харьков 310077, Украина.*

В.Ф. Клепиков

*Научно-технический центр электрофизи-
ческой обработки НАН Украины, Черны-
шевского 24,
Харьков 310002, Украина.*

Изучено поглощение энергии несимметричной поверхностной волны (ПВ) в неоднородном по плотности плазменном столбе, поддерживаемом этими волнами. Показано, что резонансное поглощение энергии в областях, где частота волны равна плазменной частоте, может стать существенным в газо-

вом разряде, поддерживаемом ВЧ волной при низком давлении. Таким образом, доля передаваемой энергии от ПВ в плазму при низких давлениях может быть увеличена благодаря резонансному нагреву. Исследована зависимость резонансного поглощения энергии от параметров структуры и ПВ.

В настоящее время возрос интерес к разрядам, создаваемым и поддерживаемым высокочастотными ПВ [1-4]. Это связано с возможностью широкого применения этих разрядов в технологических процессах. Особенно интересны для технологического применения разряды, поддерживаемые ПВ при низких давлениях (порядка и меньше нескольких Па). Это объясняется тем, что при этих давлениях возможно создание однородной плазмы в больших объемах [5,6]. Однако, при низких давлениях длина свободного пробега электронов порядка размеров системы и доля энергии, передаваемой от ПВ частицам плазмы за счет электрон-атомных столкновений также мала. Последняя, как известно, прямо пропорциональна частоте электрон-атомных столкновений и обратно пропорциональна частоте ПВ. Таким образом, поиск эффективных механизмов передачи энергии от ПВ к частицам плазмы при низких давлениях является актуальным. В данной работе показано, что передача энергии от ПВ к частицам плазмы может быть увеличена благодаря резонансному поглощению энергии в неоднородных областях плазмы [7,8], где частота ПВ ω равна плазменной частоте ω_{pe} . Исследование проведено для несимметричных ПВ, распространяющихся в диэлектрической цилиндрической трубке, заполненной плазмой. Будем предполагать, что толщина диэлектрической трубки мала по сравнению с глубиной проникновения поля ПВ и влиянием диэлектрика на дисперсию ПВ в дальнейшем будем пренебрегать.

Дисперсионные свойства и затухание несимметричных ПВ в плазменном столбе с переходной областью.

Рассмотрим неограниченный и однородный вдоль оси z плазменный цилиндр радиуса $R + d$, помещенный в вакуум. Будем считать, что плотность плазмы n постоянна в объеме плазменного столба $r < R$ и равна n_0 . В слое $R < r < R + d$ плотность меняется от n_0 до нулевого значения на границе плазмы с вакуумом. Предполагаем, что толщина переходной области мала по сравнению с радиусом однородного плазменного столба: $d \ll R$. Такие профили плотности плазмы типичны для газовых разрядов, поддерживаемых ПВ при низ-

ких давлениях в условиях амбиполярного режима ухода частиц из плазмы [2]. В данной структуре в диапазоне частот: $\nu \ll \omega < \bar{\omega}_{pe} / \sqrt{2}$ (где ν — частота электронно-атомных столкновений, $\bar{\omega}_{pe}$ — средняя плазменная частота в волноводе) может распространяться медленная ($\omega / k_3 \ll c$, где k_3 — волновое число ПВ, c — скорость света в вакууме) несимметричная ПВ [9].

Для этой ПВ зависимость потенциала Ψ от координат и времени имеет вид:

$$\Psi = \sum_{m=-\infty}^{m=+\infty} \Psi_m(r) \exp[i(k_3 z + m\varphi - \omega t)], \quad (1)$$

где $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Используя соотношение $\vec{E} = -\nabla\Psi$ (где \vec{E} — напряженность электрического поля ПВ) из уравнений Пуассона и уравнений квазигидродинамики для холодной свободной плазмы, пренебрегая движением ионов нетрудно найти уравнение, описывающее пространственное распределение потенциала ПВ;

$$\text{div}(\epsilon \nabla \Psi) = 0, \quad (2)$$

где $\epsilon = 1 - (\omega_{pe}^2 / \omega(\omega + i\nu))$

Из уравнения (2) с учетом (1) можно получить уравнение для радиальной компоненты гармоник потенциала Ψ_m :

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r\epsilon \frac{d\Psi_m}{dr}) - (k_3^2 + \frac{m^2}{r^2})\epsilon\Psi_m = 0 \quad (3)$$

В области однородной плазмы ($r < R$) решение этого уравнения, принимающее конечное значение при $r = 0$, имеет вид:

$$\Psi_m(r) = A_m I_m(k_3 r), \quad (4)$$

где $I_m(k_3 r)$ — модифицированная функция Бесселя m -го порядка. A_m — постоянная величина.

В вакууме ($r > R + d$) решение уравнения (3), ограниченное на бесконечности, может быть представлено в виде:

$$\Psi_m(r) = B_m K_m(k_3 r), \quad (5)$$

где $K_m(k_3 r)$ — модифицированная функция Макдональда m -го порядка, B_m — константа.

В переходной области плотность заряженных частиц меняется резко с изменением радиуса r , и при нахождении решения уравнения (3) в этой области можно воспользоваться следующим неравенством:

$$\left| \frac{d\epsilon}{dr} \right| - \frac{|\epsilon(R)|}{d} \gg \left| k_3 + \frac{m}{R} \right| |\epsilon(R)|, \quad (6)$$

где $\epsilon(R)$ — диэлектрическая проницаемость в однородной плазме. Неравенство (6) позволяет пренебречь последним слагаемым в уравнении (3) и найти его решение в переходной области плазмы:

$$\Psi_m(r) = C_m \int_R^r \frac{dr}{\epsilon(r)} + D_m \quad (7)$$

где C_m, D_m — константы.

Используя, граничные условия, заключающиеся в том, что потенциал и его производная $d\Psi_m / dr$ непрерывны на границах плазмы с переходной областью и переходной областью с вакуумом, из уравнений (3)-(7) получим дисперсионное уравнение для рассматриваемых ПВ:

$$\epsilon(R) - \frac{I_m(k_3 R) K_m'(k_3 R)}{I_m'(k_3 R) K_m(k_3 R)} + i\pi\eta k_3 \frac{\epsilon(R) K_m'(k_3 R)}{K_m(k_3 R)} = 0, \quad (8)$$

где штрих означает производную соответствующих функций по аргументу, $\eta = (d\varepsilon / dr)_{r=r_0}^{-1}$, r_0 находится из уравнения $\varepsilon(r_0) = 0$. Вещественная часть интеграла (7) по переходной области, которая приводит к изменению дисперсионных свойств мала, и поэтому учитывается в уравнении (8). Дисперсионное уравнение (8) можно переписать в виде:

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 k_3 R I'_m(k_3 R) K_m(k_3 R) \quad (10)$$

а относительный декремент затухания ПВ имеет вид:

$$\frac{\gamma}{\omega} = \frac{\nu}{2\omega} + \frac{\pi}{2} \eta k_3^2 R \varepsilon(R) I'_m(k_3 R) K'_m(k_3 R) \quad (11)$$

Первое слагаемое в уравнении (10) — это столкновительный декремент затухания ПВ, второе слагаемое связано с резонансным поглощением энергии ПВ в неоднородной области.

Уравнения (9), (10) могут быть упрощены в предельных случаях тонкого и широкого радиусов плазменного столба:

- для тонкого радиуса ($k_3 R \ll 1$):

1) при $m = 0$ (симметричные ПВ):

$$\omega \approx \omega_{pe} k_3 R \sqrt{|\ln(k_3 R)|} / 2$$

$$\gamma / \omega = \nu / (2\omega) + \pi \eta / (2R |\ln(k_3 R)|) \quad (12a)$$

2) при $m = \pm 1$

$$\omega = \frac{\omega_{pe}}{\sqrt{2}} \left[1 - \frac{k_3^2 R^2}{4} (|\ln(k_3 R)| - 3/4) \right]$$

$$\gamma / \omega = \nu / (2\omega) + \pi \eta / (4R) \quad (12б)$$

3) при $|m| > 1$

$$\omega = \frac{\omega_{pe}}{\sqrt{2}} \left[1 - \frac{k_3^2 R^2}{4|m|(m^2 - 1)} \right]$$

$$\gamma / \omega = \nu / (2\omega) + |m| \pi \eta / (4R) \quad (12в)$$

В случае большого радиуса плазменного столба для любых m :

$$\omega = \frac{\omega_{pe}}{\sqrt{2}} \quad (12г)$$

$$\gamma / \omega = \nu / (2\omega) + \pi \eta k_3 / 4$$

Из системы уравнений (12) следует, что для плазменных столбов малого радиуса резонансное поглощение энергии ПВ возрастает с ростом азимутального числа и уменьшением радиуса плазменного столба. В случае плазмы большого радиуса это поглощение наиболее существенно для ПВ с малой длиной волны.

Оценим относительные декременты затухания, связанные со столкновениями частиц и с резонансным поглощением при параметрах, которые типичны для плазмы, создаваемой и поддерживаемой ПВ в условиях амбиполярного режима ухода заряженных частиц из плазмы. При следующих параметрах структуры: $\omega = 2\pi \times 2,45$ ГГц, $\nu = 10^8$ Гц, $R = 1$ см, $T_e = 1$ эВ (T_e — температура электронов) относительный декремент затухания ν / ω , связанный со столкновениями частиц, порядка $3,3 \times 10^{-3}$. При этих параметрах декремент затухания, обусловленный резонансным поглощением энергии в области неоднородной плазмы, равен $3m \times 10^{-3}$. При оценке декремента затухания предполагалось, что ширина переходной области порядка пяти радиусов Дебая. Из проведенных оценок декрементов

затухания следует, что при $m \gg 1$ декремент затухания, обусловленный резонансным поглощением энергии, значительно превышает столкновительный декремент затухания.

Передача энергии несимметричных ПВ частицам плазмы с учетом резонансного поглощения.

На следующем этапе нашего исследования найдем мощность энергии Q , передаваемую поверхностной волной частицам плазмы на единице длины плазменного столба с учетом резонансного поглощения энергии в области неоднородной плазмы.

При этом выражение для Q имеет следующий вид [10]:

$$Q = Q_0 + Q_{res} \quad (13)$$

где $Q_0 = \frac{e^2}{2m_e \omega^2} \int_0^R n v |\bar{E}^p|^2 2\pi r dr$ — энергия, теряемая ПВ на единице длины разряда в единицу времени в области однородной плазмы; $|\bar{E}^p|^2 = |E_r^p|^2 + |E_\phi^p|^2 + |\bar{E}_z^p|^2$; E_r^p, E_ϕ^p, E_z^p — компоненты электрического поля в области однородной плазмы.

$Q_{res} = \frac{e^2}{2m_e \omega^2} \int_R^{R+d} n v_{eff} |E_r^{tr}|^2 2\pi r dr$ — мощность, передаваемая ПВ частицам плазмы на единице длины разряда в области неоднородной плазмы. E_r^{tr} — радиальная компонента электрического поля в переходном слое, v_{eff} — эффективная частота столкновений, связанная со столкновениями частиц, а также с передачей энергии ПВ благодаря неоднородности плотности плазмы. В области неоднородной плазмы радиальная составляющая электрического поля E значительно превышает остальные компоненты поля ПВ. Поэтому, в выражении для Q_{res} остальными компонентами поля ПВ мы пренебрегли.

Рассмотрим случай, когда плазма была предварительно создана, а ПВ выполняет поддерживающую роль. Будем также предполагать, что возбуждена лишь одна гармоника с номером m . Из уравнения (12) следует, что выбор m определяется частотой генератора, размерами волновода, а также концентрацией предварительно созданной плазмы.

Компоненты электрического поля ПВ могут быть легко получены из уравнения $\bar{E}_m = -\nabla \Psi_m$ и имеют следующий вид:

-в области однородной плазмы:

$$\begin{aligned} E_{zm}^p &= E_{zm}(R) \frac{I_m(k_3 r)}{I_m(k_3 R)}; \\ E_{rm}^p &= -\frac{i E_{zm}(R)}{k_3 I_m(k_3 R)} I_m'(k_3 r); \\ E_{\phi m}^p &= E_{zm}(R) \frac{m}{k_3 R} \frac{I_m(k_3 r)}{I_m(k_3 R)}, \end{aligned} \quad (14)$$

где $E_{zm}(R)$ — компонента электрического поля на границе $r = R$.
В переходной области:

$$E_{rm}^{tr} = \frac{C_m}{\epsilon(r)}, \quad (15)$$

где $C_m = i \epsilon(R) \frac{E_{zm}(R)}{I_m(k_3 R)} I_m'(k_3 R)$.

В переходной области диэлектрическая проницаемость плазмы равна:
 $\epsilon(r) \approx 1 - n(r) / n_c + i v_{eff} / \omega$.

Подставляя уравнения (13), (14) в (12) получим выражения для Q_0 и Q_{res} :

$$Q_0^m = \frac{\pi e^2 \nu m}{m_e \omega^2} \frac{|E_{zm}(R)|^2}{(k_3 I_m(k_3 R))^2} \int_0^R \left[\left(k_3^2 + \frac{m^2}{r^2} \right) I_m^2(k_3 r) + (I_m'(k_3 r))^2 \right] r dr \quad (16)$$

$$Q_{res}^m \approx \frac{\pi^2 e^2 R}{2 m_e \omega^2} \eta_c \omega |C|^2 \quad (17)$$

В случае малых радиусов плазменного столба уравнения (16), (17) упрощаются:

$$Q_0^m \approx \frac{\pi e^2 \nu m E_{zm}^2(R)}{m_e \omega^2 k_3^2}$$

$$Q_{res}^m \approx \frac{\pi^2 e^2 R}{2 m_e \omega^2} \eta_c \omega \frac{\varepsilon^2 m^2 E_{zm}^2(R)}{(k_3 R)^2}$$

$$\frac{Q_{res}^m}{Q_0^m} \approx \frac{\pi \eta_c \omega \varepsilon^2(R) m}{2 \nu R}$$

Из последнего выражения видно, что роль резонансного поглощения возрастает с увеличением частоты ПВ и азимутального числа m . С ростом радиуса плазменного столба резонансное поглощение ослабевает. Роль резонансного поглощения наиболее важна при низких давлениях газа (ν уменьшается с уменьшением давления газа).

Таким образом, из результатов проведенного исследования следует, что при низких давлениях в плазменных столбах с неоднородным профилем плотности, создаваемых и поддерживаемых ПВ, возрастает резонансное поглощение энергии в областях, где частота ПВ равна плазменной частоте. Благодаря этому поглощению увеличивается количество энергии, передаваемой от ПВ частицам плазмы, что приводит к повышению эффективности производства плазмы при низких давлениях.

Эта работа частично поддержана Украинским Научно-Технологическим Центром (УНТЦ), проект №317.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Asmussen, J., J. Vac. Sci. Technol. **A 7**, 883 (1989).
- [2] Moisan, M. & Zakrzewski, Z., "Radiative Processes in Discharge Plasmas", Plenum, New York 1986, p.381.
- [3] Margot, J. & Moisan M., "Microwave Discharges: Fundamentals and Applications", Plenum, New York 1993, **B 302**, 141.
- [4] Zhelyazkov, I., Atanassov V., Physics Reports **255**, 79 (1995).
- [5] Viel, V., Bernard, J and Laval, G., J. Phys. D: Appl. Phys. **29**, 1500 (1996).
- [6] Korzek, D., Werner, F., Winter, R. and Engemann, J., Plasma Sources Sci. Technol. **5**, 216, (1996).
- [7] Степанов, К.Н. ЖТФ. **10**, 773 (1965).
- [8] Романов Ю. ЖТФ **6**, 2119 (1964).
- [9] Кондратенко А.Н. Поверхностные и объемные волны в ограниченной плазме. Москва, Энергоатомиздат, 1985.
- [10] Aliev Yu. M., Maximov, A. V., Schluter, H. and Shivarova, A., J. Plasma Physics **52** 321 (1994).